

ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

塗布膜を有する被処理基板の加熱装置は、内部空間を有するチャンバと、被処理基板を加熱するためのチャンバ内と、仕切り部材と、を有する。加熱板は、チャンバ内で被処理基板を支持する載置面を有する。仕切り部材は、
5 載置面と対向するようにチャンバ内に配設される。また、仕切り部材は内部空間を第1及び第2空間に分割すると共に、第1及び第2空間を連通させる複数の孔を有する。加熱板の載置面は第1空間内に配設される。第2空間に気体流を形成するための気体流形成機構が配設され、この機構により被処理基板から発生する蒸発物が排出される。

10065419-122601